PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

54-071590

(43)Date of publication of application: 08.06.1979

(51)Int.Cl.

H01L 33/00

(21)Application number: 52-138620

// H01L 21/265

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

17.11.1977

(72)Inventor: TOYODA YUKIO

OKI YOSHIMASA

KOBAYASHI ATSUYUKI **AKASAKI ISAMU HAYASHI TAKESHI** YAMAMOTO MASAHARU

(54) GAN LIGHT EMITTING ELEMENT AND PRODUCTION OF THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To control light emitting color through current controlling by using two kinds of impurities of different light emission wavelengths.

CONSTITUTION: Zn-doped GaN 2 is formed on a sapphire substrate, and Mg ion beams 3 are radiated to create an implantation layer 4 on teh crystl surface. The ion implantation is performed by an energy multiple system to flatten the impurity distribution to a dose quantity of 1.9 × 1015cm-2. Next, the surface is covered with CVD SiO2 5 and the substrate is treated for 1 to 20 hours at 1050° C in N2, after which SiO2 is removed. Grooves 6 thicker than the thickness of i layer 4 produced through the ion implantation are provided. In is deposited on the crystal surface and grooves 6 to provide electrode. This constitution enables light emission colors to be readily changed through current controlling under the condition of a constant brightness. This may be embodied even by combining Cd, Hg, Be, etc.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54—71590

⑤Int. Cl.² H 01 L 33/00 //

H 01 L 21/265

識別記号

庁内整理番号 7377-5F **砂公開 昭和54年(1979)6月8日** 発明の数 2

7377-5F 発明の数 2 6684-5F 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈GaN発光素子およびその製造方法

②特

願 昭52-138620

22出

願 昭52(1977)11月17日

特許法第30条第1項適用 昭和52年10月13日 「第38回応用物理学会学術講演会(岡山大学 教養部において)」において発表

⑫発 明 者 豊田幸雄

川崎市多摩区生田4896番地 松

下技研株式会社内

大木芳正

同

川崎市多摩区生田4896番地 松

下技研株式会社内

同 小林敬幸

川崎市多摩区生田4896番地 松 下技研株式会社内

⑩発 明 者 赤崎勇

川崎市多摩区生田4896番地 松

下技研株式会社内

同 林猛

川崎市多摩区生田4896番地 松

下技研株式会社内

同 山本雅晴

川崎市多摩区生田4896番地 松

下技研株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

明 細 雲

1、発明の名称

 $\overline{\cdot}$.

GaN発光素子およびその製造方法

2 、特許請求の範囲

(1) 絶縁基板上に形成されたGaN結晶内に、異なる成長の発光センターとなりうる二種類以上の不純物を含む領域を有し、上記各不純物の発光成長における視感度を長波長の発光のもの程順次大きくし、かつ発光センターとなる不純物の濃度を長波長の発光のもの程順次低くしたことを特徴とするGaN発光素子。

(2) 不純物のうち少なくとも二種類が 2n と Mg であることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記 載の GaN発光素子。

(3) 絶縁基板上のGaN結晶に、より長波長側の発光波長に対する視感度が大きく、かつより長波長側の発光センターとなる不純物器度が低いことを満たすように選ばれた二種類以上の不純物を導入する工程を具備し、この不純物の導入のうち、少なくとも一種類の不純物についてはイオン注入法

で行うことを特徴とするGaN発光素子の製造方法。 (4) 不純物のうち少なくとも二種類がZn とMg であることを特徴とする特許請求の範囲第3項記 載のGaN発光素子の製造方法。

3、発明の詳細な説明

本発明は、電流制御により輝度の変動を2倍以 内にして発光色を可変できるNaG発光紫子および その製造方法に関するものである。

GaNを材料として用いた発光素子においては、 禁外,業,骨色の短波長発光が可能であり、また 適当な不純物を適当量導入すれば、黄色から赤色 などの長波長光の発光も可能となり、可視光全域 にわたる発光が得られることが知られている。し かしながら、従来行われているように、一種類の 不純物のみを導入する方法では、どのようにして も単一の柔子からは単一の発光色しか得られない。

そこで、二種類以上の異った不純物の導入を行 えば、エネルギー単位として不連続な複数の不純 物単位を存在せしめることができるので、それら の不純物単位のうちの特定単位による発光を選択

特別昭54-71590(2)

しうる素子動作上の制御が可能となる。ここで選択制御が可能となるためには、各不純物準位のキャリア捕獲確率、寿命等の特性に差がなければならない。

二種類以上の不純物準化が存在する時、概念で

. . .

3

· • ,

二種類以上の不純物単位が存在する時、傑い不統物単位程キャリアを捕獲しやすく、寿命も長いのでこの不純物単位に関して長波長の発光が成でをが成れた。 さらに、キャリア注入・励起の強が変を増加させると最初に起っていた発光に飽和が変り、別の不純物単位による発光が生ずる。 後第1の飽和後さらに注入・励起を増大するととにいい、第2の発光で主となる。 従れて、この含む GaN 結晶を用いて、発光累子を作成すれば発光色を電流制御により変えることができる。

とこで、重要な点は第2の発光が起りうる場合でも、輝度が問題となることである。第1の発光 色の視感度が第2の発光色の視感度より大きければ、輝度の変動を最小限に抑えて発光色を変化さ 次に、二種類以上の不純物の導入にあたっては、 次の点が考慮されればならない。第1は、二種類 以上の不純物のいずれについても、発光素子の接 合電流が発光に有効に寄与する領域である同一の 場所に導入しなければならないこと。第2は、輝

度変化が2倍以内で色相が可変になるためには、 それらの不純物濃度について、その相対値が厳密 に制御されねばならないことである。従って、こ れらの点から従来行われている成長時の導入法の みでは、二種類以上の不純物導入は困難である。 二種類以上の不純物導入を結晶成長時に行ならに は、反応管が複雑化するなど、実際の技術上の問 題点もあるが、前述の第2の点から不純物濃度は 厳密に制御されねばならないので有効でない。こ の点から、イオン注入による方法がもっとも有効 である。二種類以上の不純物の導入のすべてをィ オン注入法で行なってもよいが、一方の不純物の 導入は結晶成長時に行う方法を用いて、イオン注 入法との組合せにより本発明の素子の作成すると とも有効である。なぜたら、本発明による案子の 特性を実現するには、前述のように、特にそれぞ れの不純物の濃度の相対値が重要となるが、第二 の不純物導入をイオン注入で行なえば、先に成長 時に導入した不純物濃度に対応して、その濃度を 厳密に設定し導入しりるからである。

以下実施例において、具体的に説明する。 実施例

まず第1図(a)で示されるように、サファイア基板1上の20 をドープしてあるGaN結晶2にMg
のイオンビーム3を照射してイオン注入を行い、

特開 昭54-71590(3)

(b) に示すように、結晶の要面に注入層4を形成する。イオン注入は、不純物の分布が平坦になるようにエネルギー多重方式により行い余ドーズ量は1.9×10^{15cm-2}である。次に(c)に示すように結晶表面に保護膜として、CVD法により、厚さ2000Å程度のSiO₂ 膜を附着させた後、1060℃の温度で1時間~20時間の熱処理を窒素雰囲気中で行う。その後SiO₂ 膜を除去して、(d)に示すように、イオン注入により形成されたi 届4の厚さを越えるに十分な栗さの溝6を切って、(e)の如く結晶表面と溝6の両方に、1n金属をドットまたは蒸着などにより附着して電極を構成す

 $\overline{}$

以上のようにして作成された発光案子のエレクトロルミネッセンス・スペクトルの電流による変化を第2図に示す。(a)、(b)はそれぞれ熱処理時間が3時間、20時間のものである。(電流値は(a)で、(f)は4mA、(c)は10mA (b)で()は6mA、(c)は10mA、(f)は16mAである)両者を通じてスペクトル線が~380nm、~430nm、

~610nmの三本が見られる。これらは、それぞれMg アクセブタ単位 , Zn アクセブタ単位 , およびMg の錯体による深い単位に関係した発光である。第2図で示したそれぞれのスペクトルに対応して、輝度の相対値 Y と、色度 (x , y)を次式により求めた。

$$\begin{cases}
Y = \int \frac{dP}{d\lambda} V_y d\lambda \\
x = \frac{X}{X + Y + Z}, \quad y = \frac{Y}{X + Y + Z}
\end{cases}$$

但し、

 $X = \int \frac{dP}{d\lambda} \cdot V_x d\lambda$, $Z = \int \frac{dP}{d\lambda} \cdot V_z d\lambda$, であり、P は、スペクトルの各液長での強度、 λ は 放長、 V_x , V_y , V_z はそれぞれ赤 , 禄 , 宵の視感度 因子である。

第3図は第2図(a),(b)それぞれの色相変化を色度図(x,y)において示したものである。実験矢印が電流量を増加させた時の、輝度Y一定の範囲での色相変化である。この実施例では、電流の増加により長波長側の発光が飽和に達した後わずか

に波少したため厳密に輝度が一定に保たれている。 点線は、輝度 Y の変化がある場合を含めての色相 変化である。これから明らかなように、電流制御 により、輝度一定の条件で、

- b) では背緑色 青色
- a) では青色 → 青紫色 なる変化を示している。

以上、Zn と Mg の二種の不純物を用いて、電 統制御により発光色を変化させたが、他の不純物 例えば Cd (青), Hg (緑), Be (高濃度で黄)など をも組合せて、本発明を実施することも有効であ

以上の如く本発明は、発光波長の異なる二種類の不純物を用いて、電流を制御することにより発 光色を制御しりるGaN発光案子及びその製造方法 を提供するものであり、輝度一定の条件で容易に 発光色を変えることができる等の特徴を有する。

4、図面の簡単な説明

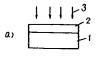
第1図(a)~(a) は本発明のGaN発光素子の製造工程を示す断面図、第2図(a),(b) は本発明のGaN発

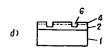
光案子のエレクトロルミネッセンス・スペクトル を示す図、第3図は色度図である。

1 ······ サファイア基板、2 ······ GaN結晶、
 4 ····· i 層。

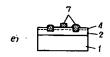
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

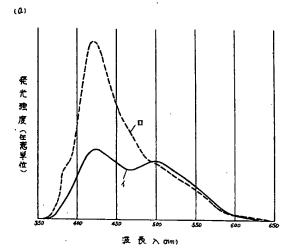
•



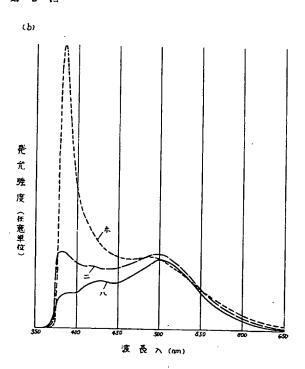




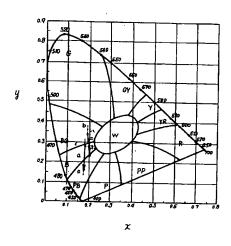




第 2 図



第 3 図



特許法第17条の2の規定による補正の掲載

١

四和 52 年特許願第 138620 号 (特開四54-71590 号 昭和 54 年 6 月 8 日発行 公開特許公報 54-716 号掲載 1 については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 7 (2)

'Int. C 1 '.	識別記号	庁内整理番号
H01L 33/00		6666-5F
// HO1L 21/265		6851-5F
	l i	

手続補正書

昭和58年8月26日

特許庁長官殿

1事件の表示

昭和 52年 特 許 願 第 138620 号

2 発明の名称

GaN発光素子およびその製造方法

3 補正をする者

事件との関係 特 許 出 願 人 住 所 大阪府門真市大字門真1006番地 名 称 (582)松下電器産業株式会社 代表者 山 下 俊 彦

4 代理人 〒571

住 所 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

氏 名 (5971) 弁理士 中 尾 敏 男(二定元) (にか 1名) (以土)

-(连结元 電話(東京)437-1121 東京治現分室)

5 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の概



6、補正の内容

- (1) 明細智第2頁第7行の「NaG発光素子」を 「GaN発光素子」に補正します。
- (2) 同第4頁第3行の「456mm」を「456 nm」に補正します。
- (3) 同第7頁第3行の「余ドーズ盤」を「全ドーズ盤」に補正します。